Металлургия. Металлообработка. Машиностроение

УДК 621.923.7

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНО ПОЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Канд. техн. наук, доц. СИНЬКЕВИЧ Ю. В., инж. ГРИНЕВИЧ А. А., канд. техн. наук ЯНКОВСКИЙ И. Н.

Белорусский национальный технический университет

Шероховатость поверхности, являющаяся одной из основных геометрических характеристик качества поверхности, оказывает значительное влияние на эксплуатационные показатели детали [1]. Механизм формирования топографии поверхности при электроимпульсном полировании (ЭИП) достаточно сложен, включает в себя физические, химические, геометрические и технологические аспекты, которые взаимосвязаны и на сегодняшний день мало изучены.

В настоящее время существует несколько гипотез о механизме сглаживания микронеровностей поверхности в процессе ЭИП [2–8]. Они основываются на опыте электроэрозионной обработки и электрохимического полирования и сводятся к тому, что напряженность электриче-

Вестник БНТУ, № 5, 2011

ского поля на вершинах микровыступов обрабатываемой поверхности должна быть значительно выше по сравнению с микровпадинами. Поэтому, по мнению авторов, возникновение электрических разрядов происходит преимущественно на вершинах микровыступов. Формирование топографии поверхности в процессе полирования обеспечивается за счет избирательного электроэрозионного и электрохимического сглаживания микровыступов поверхности. Однако предложенные гипотезы, в том числе в части типов и механизмов электрических разрядов в парогазовой оболочке (ПГО) и ионного распыления оксидных слоев, не имеют ни экспериментального, ни теоретического обоснования. Эти гипотезы ошибочно базируются на том факте, что на профилограмме реальной поверхности микровыступы имеют островершинный вид. На самом деле этот эффект связан с различием в масштабах вертикального и горизонтального увеличения профилограммы и показан на рис. 1 [9].



Рис. 1. Влияние горизонтального увеличения профилограммы на внешний вид профиля поверхности

Постановка задачи. Известно [9, 10], что в структуру шероховатости поверхности входят как закономерно, так и случайно расположенные неровности. Поэтому реальный профиль поверхности, полученный в результате ее обработки различными методами, представляет собой композицию систематической и случайной составляющих, а уравнение профиля, учитывающее оба вида неровностей, имеет вид [10]

$$x(t) = x_{\beta}(t) + x_{\gamma}(t)$$

где $x_{\beta}(t)$ – периодическая функция; $x_{\gamma}(t)$ – нормальный эргодический стационарный процесс со средним значением равным нулю.

Систематическая составляющая профиля обусловлена факторами, постоянно действующими в процессе обработки, и представляет собой основные микронеровности, которые на поверхности расположены определенным образом. Случайная составляющая образуется за счет воздействия различных нерегулярных технологических и физических факторов и накладывается на поверхность основных микронеровностей [9, 11]. Она имеет вероятностный характер и является реализацией случайной стационарной функции. В соответствии с теорией случайных функций под случайной стационарной функцией понимается такая функция, которая изменяется примерно однородно и имеет вид непрерывных случайных колебаний около некоторого среднего значения, причем ни средняя амплитуда, ни характер этих колебаний существенно не изменяются с течением времени [12].

За периодическую функцию в данной работе принята модель вида [10]

$$x_{\beta}(t) = A\cos(\omega t + \psi),$$

где A – детерминированная величина; ψ – случайная величина, равномерно распределенная на интервале [0–2 π]; ω – циклическая частота.

Для описания случайного процесса в нашем случае будет достаточно определения корреляционной функции $K(\tau)$ непрерывного в среднем квадратичном стационарного случайного процесса, которая по теореме Бигхофа–Хинчина может быть представлена в виде [10]

$$K(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda\tau} dF(\lambda),$$

где $F(\lambda)$ – вещественная неубывающая ограниченная функция; τ – разница аргументов процесса; λ – частота спектра; *i* – мнимая единица.

Статистическая оценка корреляционной функции $\hat{K}(\tau)$ находится по формуле [13]

$$\widehat{K}(\tau) = \frac{1}{n-\tau} \sum_{i=1}^{n-\tau} (y_i - \overline{y})(y_{i+\tau} - \overline{y}), \qquad (1)$$

где n – количество измеренных точек реализации процесса; y_i – ордината *i*-й точки; \overline{y} – среднее арифметическое измеренных ординат.

Функция $F(\lambda)$ называется спектральной функцией процесса x(t). Если $F(\lambda)$ абсолютно непрерывна, то она представляется в виде [10]

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\lambda} s(\lambda) d\lambda,$$

где $s(\lambda)$ – спектральная плотность процесса x(t).

Если известна корреляционная функция $K(\tau)$, то спектральная плотность $s(\lambda)$ определяется по формуле [10]

$$s(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\lambda} e^{-i\lambda\tau} K(\tau) d\tau.$$

Для оценки спектральной плотности $s(\lambda)$ по реализации стационарного процесса на конечном интервале пользуются полученной оценкой корреляционной функции $\hat{K}(\tau)$. Тогда статистической оценкой спектральной плотности $\hat{s}(\lambda)$ будет функция вида [10]

$$\widehat{s}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^{L} e^{-i\lambda\tau} \widehat{K}(\tau) d\tau, \qquad (2)$$

где 2*L* – выбранная длина интервала реализации процесса.

Поскольку коррелограмма профиля поверхности, содержащего систематическую и случайную составляющие, является композицией коррелограмм систематической и случайной составляющих, то она позволяет получать характеристики как совокупного профиля, так и раздельно периодической и случайной составляющих. В этом случае структурная формула корреляционной функции имеет вид [12]

$$K(\tau) = K_{\beta}(\tau) + K_{\gamma}(\tau) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} A_i^2 \cos\left(\frac{2\pi}{T_i}\tau\right) + K_{\gamma}(\tau),$$

где $K_{\beta}(\tau)$, $K_{\gamma}(\tau)$ – корреляционные функции соответственно систематической и случайной составляющих профиля поверхности; A_i , T_i – соответственно амплитуда и период *i*-й гармоники профиля.

Из того, что в корреляционной функции систематической составляющей $K_{\beta}(\tau)$ амплитуды гармоник возводятся в квадрат, следует, что коррелограмма профиля поверхности выделяет более мощные гармоники. В случае, когда возникает необходимость анализа маломощных гармоник профиля, необходимо исключить из корреляционного преобразования наиболее мощную систематическую гармонику, приняв ее в качестве линии отсчета ординат профиля.

Для характеристики доли случайной составляющей в реальном профиле поверхности используется коэффициент случайности профиля у [12]

$$\gamma = \frac{Rq_{\gamma}^2}{Rq^2},$$

где Rq – среднее квадратическое отклонение профиля; Rq_{γ} – среднее квадратическое отклонение случайной составляющей профиля.

Цель данной работы – исследование вероятностно-статистическими методами механизма формирования топографии поверхности в процессе ЭИП путем корреляционного преобразования профилограмм поверхности. В данной работе не рассматриваются механизм пробоя ПГО и его влияние на шероховатость поверхности.

Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследования были выбраны углеродистая конструкционная сталь 10 (ГОСТ 1050) и коррозионно-стойкая сталь 20Х13 (ГОСТ 5632) в виде плоских образцов размерами 40×20×3 мм, которые предварительно шлифовались до уровня Ra 1,3-1,4 мкм и 0,53-0,63 мкм. Образцы из стали 10 полировали в 2%-м водном растворе хлористого аммония, из стали 20Х13 - в 6%-м водном растворе сернокислого аммония при напряжении 300 ± 5 В и температуре электролита 85 ± 1 °C. Время обработки выдерживалось с точностью ±1 с. До и после ЭИП на профилографе-профилометре Talysurf-5 фирмы Rank Taylor Hobson (Англия) снимали профилограммы поверхности образцов и измеряли параметры шероховатости Ra и *Rq*. На рис. 2 и 3 представлены профилограммы поверхности образцов из сталей 10 и 20Х13 с исходной шероховатостью поверхности соответственно *Ra* 0,63 и 0,53 мкм.

Для автоматизированной компьютерной обработки профилограммы предварительно переводили в цифровой формат путем сканирования. С полученных оцифрованных изображений в программе Paint.NET v. 3.35 удалялись линии сетки профилограмм и артефакты изображений. Таким образом, перед анализом на изображении профилограммы оставался только характерный для данного образца участок линии профиля поверхности. Для математической обработки полученных изображений и построения графиков использовали программный пакет MatLab [14] и написанную в пакете программу. Импортирование оцифрованных изображений профиля производилось с помощью MatLab Image Processing Toolbox [14]. B peзультате изображение профиля поверхности

трансформировалось в матрицу, размеры которой равны размеру изображения в пикселях. После получения матрицы по ней последовательно производили отсчет ординат профиля поверхности относительно выбранной линии отсчета, расчет значений корреляционной функции и сглаженной гистограммы профиля, а также параметра *Ra*.



Рис. 2. Профилограммы поверхности образцов из стали 10 после ЭИП в течение, мин: а – 0 (исходная шероховатость); б – 1; в – 2; г – 3; д – 5; е – 7; ж – 10; з – 15 (ГУ × 100; ВУ × 5000)

На точность расчетов параметров исследуемого профиля и построения коррелограмм большое влияние оказывает выбор линии для отсчета ординат профиля. В зависимости от вида линии профиля для выделения из профилограммы собственно шероховатости и исключения влияния на результаты расчетов волнистости и макроотклонений поверхности в качестве линии для отсчета ординат принималась прямая *L*, параллельная направлению продольного перемещения щупа профилографа, наклонная прямая LRL, сплайн SPL или линия FTW, описываемая совокупностью гармонических функций. Коэффициенты в уравнении наклонной прямой определяли по методу наименьших квадратов с помощью функции Polyfit пакета MatLab [14]. При построении сглаживающего сплайна использовали тип аппроксимации Smoothing Spline пакета MatLab [14]. При описании линии отсчета совокупностью гармонических функций использовали тип приближения Fourier пакета MatLab [14] – приближение данных отрезками ряда Фурье для $1 \le n \le 8$. Параметры, влияющие на точность приближения для последних двух методов, подбирали индивидуально для каждой профи-

лограммы до приближения значения параметра *Ra*, рассчитанного по коррелограмме к величине, измеренной профилометром.



Рис. 3. Профилограммы поверхности образцов из стали 20Х13 после ЭИП в течение, мин: а – 0 (исходная шероховатость); б – 1; в – 2; г – 3; д – 5; е – 7; ж – 10; з – 15 (ГУ × 100; ВУ × 5000)

Построение коррелограмм и спектрограмм. Построение коррелограмм профиля поверхностей выполняли по методике [15]. Расчет значений корреляционной функции производили по преобразованной для обработки профилограмм формуле (1) [16]

$$K(\tau) = K_{\beta}(\tau) + K_{\gamma}(\tau) =$$
$$= \frac{1}{l-\tau} \sum_{0}^{l-\tau} (y(x) - m_y)(y(x+\tau) - m_y),$$

где τ – переменная разность между абсциссами двух сечений профилограммы, мкм; l – длина профилограммы, мкм; y(x); $y(x + \tau)$ – ординаты профилограммы в выбранной системе координат, мкм; m_y – среднее арифметическое значение ординат профилограммы, мкм, которое рассчитывалось по формуле:

$$m_y = \frac{\sum_{i=1}^n y_i(x)}{n},$$

Вестник БНТУ, № 5, 2016

где *n* – количество измеренных ординат.

Значения т последовательно принимались равными 0; 1; 2; ...; Δx . Величина Δx представляет собой выбранный интервал на оси абсцисс профилограммы, на который она разбивается для расчета корреляционной функции. В нашем случае было принято $\Delta x = 1$ пиксель. Размер одного пикселя равнялся 0,847 мкм.

При анализе профилограмм также строили графики спектральной плотности – спектрограммы. Спектральная плотность является функцией, описывающей распределение дисперсии неровностей по частотам. Она показывает, какого рода неровности преобладают в данном профиле. По сравнению с коррелограммой ее основным достоинством является наглядность [12]. Спектральная плотность $S(\omega)$ профиля представляет собой сумму спектральных плотностей систематической $S_{\beta}(\omega)$ и случайной $S_{\gamma}(\omega)$ составляющих профиля поверхности. При построении спектрограмм расчет значений спектральной плотности выполняли по преобразованной формуле (2)

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{0}^{2l/3} K(\tau) \cos(\omega \tau),$$

где $K(\tau)$ – значение корреляционной функции в точке с абсциссой τ ; ω – частота неровностей в точке с абсциссой τ , Γ ц, $\omega = \frac{2\pi}{T}$; T – период неровностей в точке с абсциссой τ , мкм.

Шаг изменения τ и T при расчете значений спектральной плотности принимался равным шагу изменения τ при расчете коррелограмм.

Аппроксимация построенных коррелограмм производилась с помощью Curve Fitting Tool пакета MatLab [14] функцией, позволяющей учесть систематические неровности как с большим, так и с малым шагом и имеющей вид [15]

$$K(\tau) = c^2 R a^2 \left[\gamma e^{-\alpha \tau} + \beta \cos\left(\frac{2\pi}{T_{\beta}}\tau\right) + \nu \cos\left(\frac{2\pi}{T_{\nu}}\tau\right) \right],$$
(3)

где α – коэффициент частотного состава случайных неровностей; β, v – коэффициенты высот систематических неровностей соответственно с периодами T_{β} , T_{ν} ; c – коэффициент, зависящий от формы неровностей и закона их распределения по высоте (принимался равным $\sqrt{\pi/2}$ [15]).

Показатель α определяет частотный состав случайных неровностей: чем меньше значение α , тем плавнее случайные неровности и тем больше расстояние между ними [12]. Коэффициенты γ , β и ν характеризуют вклад, вносимый соответствующими составляющими шероховатости поверхности в Ra^2 , причем $\gamma + \beta + \nu = 1$. В зависимости от соотношения коэффициентов можно судить о характере неровностей поверхности.

Из формулы (3) следует, что при $\tau = 0$ корреляционная функция связана с *Ra* соотношением

$$K(0) = c^2 R a^2. \tag{4}$$

На точность аппроксимации коррелограммы большое значение оказывает выбор границ изменения параметров, который производился на основе анализа коррелограмм и спектрограмм поверхностей. По коррелограмме рассчитывались границы изменения параметров β и γ – за ориентировочные значения брались отношения $K_{\beta}(0)$ и $K_{\gamma}(0)$ к K(0). С помощью спектрограммы определяли значения шагов, соответствовав-

шие двум наибольшим пикам. Меньший шаг характеризует высокочастотные, а больший – низкочастотные гармоники систематических неровностей. После введения в программу всех данных производился расчет параметров аппроксимации коррелограмм с доверительной вероятностью 95 %. Параметр *Ra* рассчитывался по (4). Результаты расчетов представлены в табл. 1. На рис. 4 в качестве примера приведены коррелограммы поверхностей и их аппроксимация для сталей 10 и 20Х13 после ЭИП в течение 10 мин.

Обсуждение результатов исследований. В результате математической обработки профилограмм для каждой из них были построены коррелограммы, спектрограммы, сглаженные гистограммы и графики зависимостей коэффициентов корреляционной функции от продолжительности ЭИП. На рис. 5 в качестве примера представлены коррелограммы и спектрограммы поверхности образцов из сталей 10 и 20Х13 после ЭИП в течение 15 мин. Анализ полученных результатов показал, что в структуре исходной шероховатости значительное место занимают высокочастотные как случайные, так и систематические неровности с периодом до 200 мкм (рис. 6).

б

Таблица 1

TT						~
Исхолные данные	вил линии отсчет	'я оплинят п	пофиля и	знячения пя	пяметнов п	пиближения
Heatoginble gainible,	Dhig minimi or e ter	и ординат п	populati n	JIIM IVIIII/I IIM	puncipod i	phonimication

	CTb			В	-MIU	Параметры уравнения корреляционной функции						
Образец	Продолжительно ЭИП, мин	$Ra_{ m Havep}$, MKM	ERa, MKM	Тип приближени линии отсчета	Параметры приб жения*	γ	β	v	T_{eta} , мкм	<i>Т</i> _v , мкм	α	
CTaJI5 10 Ra _{nex} 1,3 MKM	0	1,30	0,95	L	_	0,715	0,138	0,147	499,4	266,3	0,040	
	1	0,70	0,66	L	-	0,646	0,339	0,015	466,8	220,3	0,016	
	2	0,49	0,38	LRL	-	0,650	0,340	0,010	609,6	260,0	0,009	
	3	0,33	0,27	SPL	1e-10	0,743	0,214	0,043	582,6	208,2	0,013	
	5	0,17	0,18	SPL	1e–7	0,636	0,117	0,247	462,8	219,8	0,066	
	7	0,16	0,16	SPL	5e-9	0,568	0,351	0,081	451,0	241,0	0,034	
	10	0,14	0,14	FTW	3	0,540	0,440	0,020	531,2	283,1	0,037	
	15	0,13	0,12	SPL	3e-9	0,481	0,456	0,093	781,7	305,7	0,037	
CTaJIb 10 Ra _{nex} 0,63 MKM	0	0,63	0,59	LR	_	0,730	0,118	0,152	345,7	72,84	0,088	
	1	0,31	0,29	SPL	1e–9	0,750	0,143	0,107	438,3	161,8	0,047	
	2	0,33	0,17	FTW	1	0,827	0,123	0,050	431,7	111,0	0,019	
	3	0,15	0,18	SPL	1e–7	0,750	0,133	0,117	307,0	158,5	0,010	
	5	0,12	0,13	SPL	5e-9	0,492	0,226	0,282	544,3	284,9	0,043	
	7	0,11	0,11	SPL	5e-8	0,800	0,070	0,130	408,0	268,0	0,074	
	10	0,10	0,10	FTW	2	0,310	0,588	0,070	527,4	308,6	0,043	
	15	0,09	0,09	FTW	2	0,621	0,289	0,091	478,0	335,0	0,088	
C TAJTE 20X13 $Ra_{ m nex}$ 1,4 MKM	0	1,40	1,25	LRL	_	0,780	0,170	0,050	193,0	143,0	0,056	
	1	1,19	1,07	LRL	_	0,740	0,110	0,150	515,0	192,1	0,044	
	2	0,97	0,91	LRL	-	0,690	0,150	0,160	549,3	203,0	0,020	
	3	0,83	0,83	SPL	2e–9	0,660	0,220	0,120	599,0	159,0	0,038	
	5	0,71	0,72	SPL	3e-8	0,540	0,120	0,340	312,0	212,0	0,040	
	7	0,68	0,68	SPL	5e-10	0,450	0,470	0,080	590,0	315,8	0,028	
	10	0,61	0,61	SPL	6e-10	0,490	0,220	0,290	622,0	430,8	0,027	
	15	0,53	0,55	FTW	3	0,590	0,230	0,180	847,0	371,2	0,017	
CTAJID 20X13 $Ra_{\rm nex}$ 0,53 Mem	0	0,53	0,53	LRL	_	0,850	0,070	0,080	294,3	82,92	0,108	
	1	0,40	0,46	SPL	1e-8	0,890	0,033	0,077	519,0	178,0	0,138	
	2	0,36	0,38	SPL	6e-8	0,787	0,095	0,118	324,9	169,9	0,079	
	3	0,35	0,36	LRL	-	0,731	0,138	0,131	408,4	313,1	0,039	
	5	0,21	0,23	SPL	3e-9	0,662	0,219	0,071	333,6	248,6	0,036	
	7	0,20	0,19	FTW	2	0,646	0,135	0,219	421,9	301,8	0,031	
	10	0,18	0,18	SPL	1e–7	0,600	0,220	0,180	217,8	181,0	0,061	
	15	0,13	0,13	SPL	9e-9	0,640	0,230	0,130	449,8	340,1	0,041	

* – для типа приближения SPL приведено значение параметра сглаживания, для FTW – количество членов в ряду.

а

16



Рис. 4. Коррелограммы поверхности и их аппроксимация: а – сталь 10, *Ra*_{исх} 0,63 мкм; б – сталь 20Х13, *Ra*_{исх} 0,53 мкм



Рис. 5. Коррелограммы (а; в) и спектрограммы (б; г) поверхности образцов после ЭИП: а; б – сталь 10, *Ra*_{исх} 0,63 мкм; в; г – сталь 20Х13, *Ra*_{исх} 0,53 мкм





Рис. 6. Спектрограммы исходной поверхности образцов: а – сталь 10, $Ra_{\text{нсх}}$ 1,3 мкм; б – то же, $Ra_{\text{нсх}}$ 0,63 мкм; в – сталь 20Х13, $Ra_{\text{нсx}}$ 1,4 мкм; г – то же, $Ra_{\text{нсx}}$ 0,53 мкм

При последовательном анализе спектрограмм видно, что амплитуды неровностей независимо от их периода убывают по мере увеличения продолжительности обработки. Рост коэффициента в свидетельствует о том, что во всех случаях наблюдается увеличение шагов систематических неровностей и повышение влияния низкочастотных неровностей на совокупную шероховатость поверхности. После 10 мин полирования происходит выделение одной или двух преобладающих низкочастотных гармоник с периодами от 180 до 600 мкм. Суммарный вклад этих гармоник в величину среднеквадратического отклонения профиля поверхности достигает 69 %. Неровности с мелким шагом и малой амплитудой постепенно уменьшаются и после 5-15 мин обработки практически исчезают из структуры шероховатости, что заметно при сравнении спектрограмм профиля, приведенных на рис. 56, г и 6. Данное изменение структуры неровностей может быть объяснено равно вероятным съемом металла со всей поверхности в процессе ЭИП.

Вид сглаженных гистограмм показывает, что закон распределения, близкий к нормальному, характерен только для исходных шлифованных поверхностей. В остальных случаях наблюдается либо асимметрия кривой, либо многовершинность, что является признаками присутствия в профиле полированной поверхности систематической компоненты [12]. Данный факт объясняется тем, что исходные поверхности получены шлифованием – методом, который придает значительную случайность профилю [10], а также снижением в процессе ЭИП влияния случайной составляющей на структуру шероховатости поверхности. При увеличении продолжительности обработки до 5-10 мин происходит плавное снижение уровня случайной составляющей, характеризующееся уменьшением коэффициента случайности профиля у. Профиль становится более однородным и периодичным. На промежутке от 10 до 15 мин обработки наблюдаются рост уровня случайной составляющей и значительное замедление темпа снижения шероховатости. Последний факт можно объяснить проявлением микроструктуры на поверхности образцов за счет более интенсивного разрушения металла на границах зерен. Это согласуется с результатами ранее проведенных исследований [17]. в которых было установлено, что минимально достижимое значение шероховатости поверхности при ЭИП зависит от химического и фазового состава полируемого сплава, размера зерна и наличия неметаллических включений.

Анализ зависимости коэффициента α от продолжительности обработки показал, что за первую минуту при ЭИП стали 10 с $Ra_{\text{нех}}$ 0,63 и 1,3 мкм и стали 20Х13 с $Ra_{\text{нех}}$ 0,53 и 1,4 мкм его значение снизилось в среднем соответственно на 52; 60; 56 и 29 %. Увеличение времени ЭИП приводит к уменьшению достигнуто-

го значения коэффициента α на промежутках 1–3 мин для стали 10 и 1–7 мин для стали 20Х13 с $Ra_{\text{нех}}$ 0,53 мкм. Дальнейшая обработка приводит к росту коэффициента α . Для стали 20Х13 с $Ra_{\text{нех}}$ 1,4 мкм снижение коэффициента α происходит во всем исследованном диапазоне продолжительности обработки. Следовательно, в процессе ЭИП случайные неровности, так же как и систематические, постепенно сглаживаются, шаг между ними увеличивается. Это происходит до тех пор, пока не начинает проявляться микроструктура поверхности. Полученные данные хорошо согласуются с результатами исследования изменения параметров шероховатости поверхности при ЭИП, представленными в [11, 18].

вывод

Установлено, что в процессе ЭИП независимо от исходной шероховатости и вида обрабатываемого материала формирование топографии поверхности происходит за счет одновременного с равной вероятностью и равной интенсивностью сглаживания микро- и субмикронеровностей поверхности. Следовательно, учитывая то, что ПГО представляет собой динамически устойчивую систему со средней толщиной, соизмеримой с высотой микронеровностей поверхности [19], пробой ПГО происходит с равной вероятностью как на вершинах, так и во впадинах микропрофиля обрабатываемой поверхности в областях случайных неоднородностей электрического поля, обусловленных, в частности, подвижностью ПГО.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Фельдштейн, Е. Э.** Управление формированием качества поверхности деталей при механической обработке / Е. Э. Фельдштейн, И. Л. Баршай, В. К. Шелег. – Минск: БНТУ, 2006. – 227 с.

2. http://www.finishing.narod.by

3. Влияние метода полирования стали на шероховатость и эксплуатационные свойства контактных поверхностей / А. А. Хмыль [и др.] // Трение и износ. – 1996. – Т. 17, № 4. – С. 491–496.

4. **Куликов, И. С.** Электролитно-плазменная обработка материалов / И. С. Куликов, С. В. Ващенко, А. Я. Каменев. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 232 с.

5. Способ электрохимического полирования изделий из хромоникелевых сталей: пат. 2118412 РФ, МПК⁶ С 25 F 3/24 / А. С. Ставышенко, С. В. Скифский, П. Е. Наук; заявитель Тюменский гос. нефтегаз. ун-т. – № 97106310; заявл. 24.04.97; опубл. 27.08.98.

6. Разработать основы теории и технологии изготовления изделий медицинского назначения [текст]: отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. темы Ю. Г. Алексеев. – Минск, 2005. – 48 с. – № ГР 20041012.

7. **Физико-механические** свойства и электрополирующие процессы в материалах, находящихся в мощных электростатических и электромагнитных полях [текст]: отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. темы А. А. Кособуцкий. – Минск, 2004. – 61 с. – № ГР 20022618.

8. Изготовить опытно-промышленный образец исследовательской установки по электролитно-плазменной обработке материалов [текст]: отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. темы А. А. Кособуцкий. – Минск, 2004. – 25 с. – № ГР 20043544.

9. **Dagnall, H. M. A.** Exploring surface texture / M. A. H. Dagnall. – LEICESTER, ENGLAND: RANK TAYLOR HOBSON, 1980. – 170 p.

10. **Хусу, А. П.** Шероховатость поверхностей: теоретико-вероятностный подход / А. П. Хусу, Ю. Р. Витенберг, В. А. Пальмов; под ред. А. А. Первозванского. – М.: Наука, 1975. – 344 с.

11. Шелег, В. К. Формирование микрогеометрии поверхности при электроимпульсном полировании / В. К. Шелег, Ю. В. Синькевич, И. Н. Янковский // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. В. Прикладные науки. – 2007. – № 8. – С. 48–52.

12. Витенберг, Ю. Р. Шероховатость поверхности и методы ее оценки / Ю. Р. Витенберг. – Л.: Судостроение, 1971. – 101 с.

13. Смирнов, Н. В. Краткий курс математической статистики для технических приложений / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. – М.: Физматгиз, 1959. – 436 с.

14. **Ануфриев, И. Е.** МАТLAВ 7 / И. Е. Ануфриев, А. Б. Смирнов, Е. Н. Смирнова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.

15. Витенберг, Ю. Р. Оценка шероховатости с помопцью корреляционных функций / Ю. Р. Витенберг // Вестник машиностроения. – 1969. – № 1. – С. 55–57.

16. **Расчет и** построение коррелограмм уплотняющих поверхностей деталей судовой арматуры / Г. С. Беляев [и др.] // Судостроение. – 1971. – № 6. – С. 46–49.

17. Исследование параметров шероховатости поверхности стальных деталей после электроимпульсного полирования и нанесения тонкопленочных покрытий / Е. Я. Головкина [и др.] // Известия вузов СССР. Сер. Маппиностроение. – 1989. – № 6. – С. 134–138.

18. Синькевич, Ю. В. Обеспечение геометрических параметров качества поверхности электроимпульсным полированием / Ю. В. Синькевич, И. Н. Янковский // Про-грессивные технологии и системы мапшиностроения: междунар. сб. науч. тр. / Донецкий нац. техн. ун.-т. – Донецк, 2006. – Вып. 32. – С. 200–206.

19. Синькевич, Ю. В. Физико-математическая модель процесса электроимпульсного полирования / Ю. В. Синькевич, И. Н. Янковский // Прогрессивные технологии и системы мапиностроения: междунар. сб. науч. тр. / Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2006. – Вып. 32. – С. 206–212.

Поступила 04.05.2011